

連続溶解還元炉の反応特性  
(連続溶解還元技術に関する研究-XI)

金材技研

○福沢安光, 松木文明, 笠原 章

尾崎 太, 福沢 章, 吉松史朗

1. 緒言 当研では固体還元法と電弧炉による還元ペレットの連続溶解還元法を組合せた製鉄プロセスの開発を行ってきた。本報ではこの連続溶解還元炉内の還元ペレットの溶解による溶湯の希釈現象を基準とした溶湯中の諸元素の反応特性についての考察を行う。

2. 実験方法 連続溶解還元炉は滞留量約1.5t(1300kVA), 炉床反覆式の異形電弧炉を用い、ペレットの装入と溶鉄、溶津の排出を連続的に行なう。熱間装入実験では特殊ロッタリーキルン<sup>1)</sup>を用いて500~800℃に予熱した。ペレットはMidrex法、HYL法によるものとダストペレットを用い、初湯には鉄鉱と銅屑を用いた。ペレットの装入量は1~1.8t、装入時間40~100分、装入速度は15~40kg/minで行なう。金属化率を調整するため鉄鉱石を1.5~7kg/minの流量で混合装入した。溶鉄、溶津のサンプリングは10分間隔で行なう。造漿剤はほとんど使用せず助燃剤は天井よりの自由落下か簡易的なインジェクションで装入した。溶湯の平均温度は1450~1630°Cを行なう。

3. 結果と考察 スラグ塩基度( $\text{CaO}/\text{SiO}_2$ )がほぼ1以下の操業での脱P反応は起らないと仮定し、ペレットの含有するP濃度が低いことから出湯P濃度の時間変化の指數回帰(希釈曲線)より求めた時定数( $T_p$ )と操業前の炉内実測より求めた溶湯滞留量と装入鉄流量

から得た時定数(溶湯滞留時間:Tcal)との関係をFig.1に示す。

一群の●印を除きTcalとTpとは1:1の対応が認められる。Fig.2でTpと塩基度の関係をみると、Fig.1の●印は $\text{CaO}/\text{SiO}_2$ が1前後の相対的に高塩基度域に存在するのにに対し○印は0.6以下に存在する。 $(\text{CaO}+\text{MgO})/(\text{SiO}_2+\text{Al}_2\text{O}_3)$ ではそれが1.2以上、1以下であった。これより $\text{CaO}/\text{SiO}_2 < 0.6$ の操業でのP濃度の減少はペレット装入による希釈効果によると言える。この場合のTpより求めた溶湯滞留量は実測値の±15%を収めた。

炉内の混合・希釈について上述の取扱いが可能ることと鋼トL-サーによる均一混合時間が1~2minであることにより本炉内を完全混合槽とみなす。スラグ・メタル反応を擬1次と仮定し、 $\text{Si}, \text{Mn}$ の酸化反応に関する係数( $k_{\text{Si}}, k_{\text{Mn}}$ )を導出した結果  $k_{\text{Si}} = 5 \sim 15 \times 10^{-2} (\text{min}^{-1})$ ,  $k_{\text{Mn}} = 2 \sim 7 \times 10^{-2} (\text{min}^{-1})$  が得られた。すなわち成分为Aの炉内蓄積は  $dC_{\text{Aout}}/dt = (C_{\text{Ain}} - C_{\text{Aout}})/T_{\text{cal}} - k_1 C_{\text{Aout}}$ ,  $C_{\text{Ain}}, C_{\text{Aout}}$ : A成分の流入、流出濃度,  $k_1$ : 機1次反応速度係数,  $t = 0$  で  $C_{\text{Aout}} = \text{CAO}$  の場合とすると  $C_{\text{Aout}} = C_{\text{Ain}} [1 - \exp\{-t(1 + k_1 T_{\text{cal}})\}] / (1 + k_1 T_{\text{cal}}) + \text{CAO} \exp\{-t(1 + k_1 T_{\text{cal}})\} / T_{\text{cal}}$ 。装入ペレット中の $\text{Si}, \text{Mn}$ は共に酸化物で存在すると考えられるため、上式の右辺第一項は無視できる。次に第2項を  $(1 + k_1 T_{\text{cal}}) / T_{\text{cal}} = 1/T_A$  ( $T_A$ : A成分の希釈曲線から得られる見掛けの時定数) とおくことにより  $k_1$  が求まる。

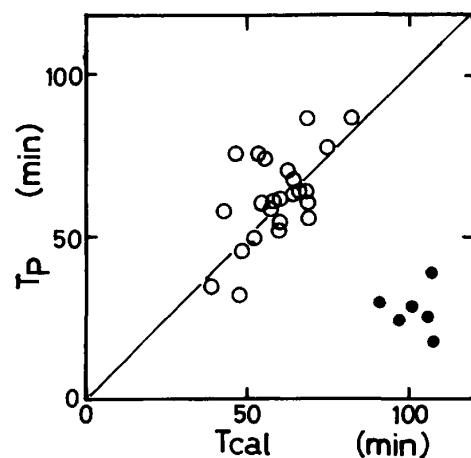


Fig.1. Relationship between Tcal and Tp

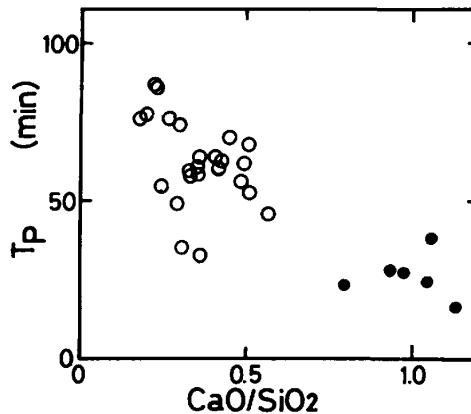


Fig.2. Effect of  $\text{CaO}/\text{SiO}_2$  to  $T_p$

1) 中山吉松ら 金材技研 研究報告集2 (1981) P1